Išradimas skirtas steviolio glikozidų kiekio saldžiosios stevijos (*Stevia rebaudiana* Bertoni) augaluose padidinimo būdui, taikant stevijos sėklų apdorojimą kondensatoriaus tipo iškrovos šalta plazma prieš sėją. Sėklos supilamos vienu sluoksniu į sterilią stiklinę 10 cm skersmens Petri lėkštelę, kuri patalpinama tarp dviejų lygiagrečių vėsinamų 120 mm diametro varinių elektrodų, įmontuotų hermetiškoje nerūdijančio plieno 0,053 m³ tūrio vakuuminėje kameroje, ant apatinio elektrodo. Kameroje sukuriamas 100-200 Pa vakuumas. Darbinės dujos – likutinis oras. Atstumas tarp sėklų ir viršutinio plazmos elektrodo – 1,7 cm. Sėklos apdorojamos 0,5-7 min. 0,6-0,7 W/cm² galios tankio iškrova. Apdorotos sėklos laikomos 20-25°C temperatūroje tamsoje 6 dienas, po to pasėjamos ir augalai auginami įprastomis sąlygomis. Panaudojant šiame išradime aprašomą technologiją ‒ trumpalaikį stevijos sėklų apdorojimą kondensatoriaus tipo iškrovos šalta plazma, galima ženkliai ‒ nuo1,5 iki 7 kartų ‒ padidinti atskirų steviolio glikozidų ir bendrą jų kiekį augale, net ir veislėse, pasižyminčiose dideliu steviolio glikozidų kiekiu.